

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成17年4月7日(2005.4.7)

【公開番号】特開2000-268768(P2000-268768A)

【公開日】平成12年9月29日(2000.9.29)

【出願番号】特願平11-73147

【国際特許分類第7版】

H 01 J 37/317

H 01 J 37/20

H 01 J 37/22

H 01 J 37/28

H 01 L 21/66

【F I】

H 01 J 37/317 D

H 01 J 37/20 D

H 01 J 37/22 502 A

H 01 J 37/28 B

H 01 L 21/66 J

H 01 L 21/66 N

【手続補正書】

【提出日】平成16年5月12日(2004.5.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

少なくともX, Y, チルト方向にウエハ試料を移動する試料移動手段と、集束したイオンビームを照射して前記試料を加工する手段と、前記試料に集束したイオンビームを走査して走査イオン顕微鏡像を取得する手段と、試料内の観察点を含む特定領域をFIB加工を利用して該試料から分離(サンプリング)する手段を備えた集束イオンビーム装置において、試料内の観察点アドレス情報を外部装置から取得する手段、該アドレス情報を基に試料ステージを駆動する試料移動手段、該観察点の走査電子顕微鏡像を外部装置から取得する手段、該走査電子顕微鏡像を画面上に表示する手段を備えたことを特徴とする集束イオンビーム装置。

【請求項2】

前記走査電子顕微鏡像と前記走査イオン顕微鏡像を同一画面に表示する手段を備えることを特徴とする請求項1記載の集束イオンビーム装置。

【請求項3】

前記アドレス情報は集束イオンビーム装置に接続された走査型電子顕微鏡から発生した情報であることを特徴とする請求項1または2記載の集束イオンビーム装置。